

maxLIGHT pro



无狭缝平场XUV光谱仪和光束分析仪

SXR
XUV
VUV



hpspectroscopy

特征

光源直接成像

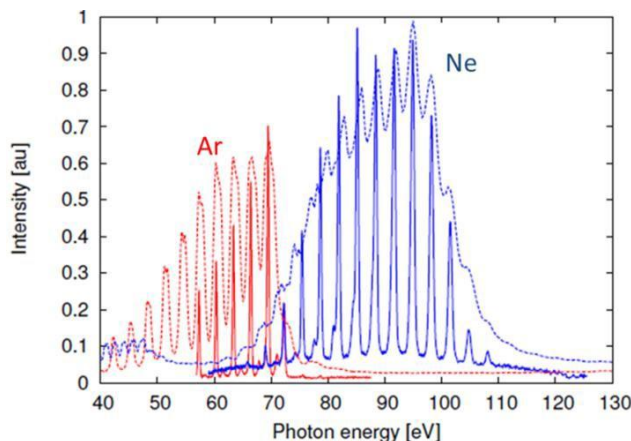
- 光谱范围覆盖1-200nm
- 通过无缝设计提供光谱范围内最高的效率：无需对准敏感的窄入口狭缝
- 相较标准产品约20倍的收集效率提升以获得极高信噪比

高效精准

- 绝对光栅位置监控，用于保持光栅对准
- 高效像差校正平场光栅
- 集成式光束分析仪
- 双杂散光滤光片
- 友好的软件控制体验

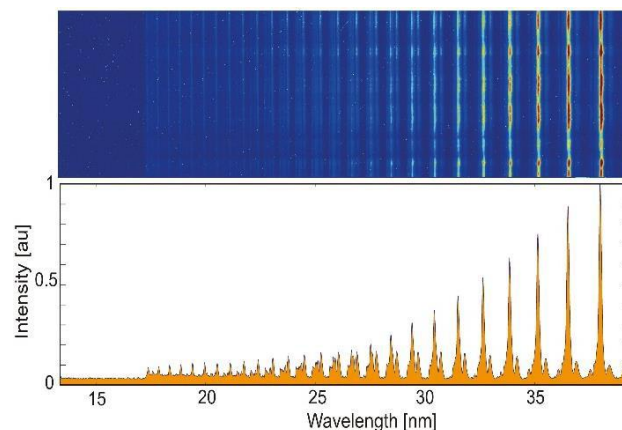
定制化服务

- 每个光谱仪都是定制的，以精确匹配用户的应用
- 可适配用户实验腔体
- 特殊光路几何构型
- 用户可定义的滤光片安装方案



在相同的信号强度下，与标准光谱仪（虚线）相比，maxLIGHT pro光谱仪（实线）的分辨率明显更高。要获得等价的光谱分辨率，传统光谱仪技术需要设置窄狭缝，从而显著降低信号强度。无狭缝技术则可以同时兼顾分辨率和信号强度。

(data courtesy of Prof. C. Hauri, Paul Scherrer Inst.)



参考光谱示例证明了maxLIGHT光谱仪的分辨能力。如图所示为飞秒激光脉冲和固体靶相互作用后，经滤光片过滤后的高次谐波谱。谐波产生过程中所固有的精细结构谱可以被maxLIGHT光谱仪清晰地分辨出来。图片上半部分：由X射线CCD相机记录的原始图像。图片下半部分：通过列合并获得的谐波频谱。
Plasma Phys. Control. Fusion 53 124021 (2011)

技术参数

Topology类型	像差校正平场光谱仪和光束分析仪		
波长范围	1-200nm		
光源距离	可根据用户实际光路灵活调整		
探测器类型	CCD or MCP/CMOS		
真空兼容度	<10 ⁻⁶ mbar (UHV超高真空版可定制)		
无狭缝技术	含		
入射狭缝	可调		
光栅定位	闭环电控台		
滤光片插入装置	含		
控制接口	USB 或 Ethernet		
软件	Windows UI and Labview/VB/C/C++ SDK		
定制化	可根据需求定制		
可选项	非磁性, 旋转几何, 偏振测量等		
	SXR	XUV	VUV
波长范围	1-20nm	5-80nm	40-200nm
色散能力	0.2-0.4nm/mm	0.5-1.3nm/mm	0.9-1.6nm/mm
分辨率	<0.015nm at 10nm	<0.028nm at 40nm	<0.05nm at 120nm



关注我们

请联系我们**北京众星联恒科技有限公司**

北京市海淀区信息路1号国际创业园西区2号楼1305

电话: +86-10-86467571 邮箱:sales@top-unistar.com